

MKI-50シリーズ

プロセス酸素分析計



MKI-50SUは、各種製造プロセスで酸化防止のために使われる不活性ガスの酸素濃度監視に最適な分析計です。装置に供給されるガスだけでなく、装置内の雰囲気も計測でき、お客様の製品・部品の品質確保や歩留まり向上に貢献致します。

用途

- 各種プロセスにおける酸化防止雰囲気ガス (N₂等) の酸素モニター
- 窒素リフロー炉、各種熱処理炉
- UV装置、EB装置等
- ガス製造装置・充填装置・混合装置の酸素モニター
- 各種膜・フィルム製品の酸素透過を調べる装置等
- グローブボックス等、各種研究開発

特徴

- エアー校正が可能 (標準ガス不要)
- 応答迅速
- シンプルな操作
- 最小限のメンテナンス
- 軽量・小型、経済的

プロセス酸素分析計 MKI-50シリーズ

仕様

測定原理	クラーク型ガルバニ電池式
型式	MKI-50SU (ガス出入口電磁弁なし) MKI-50SL (ガス出入口電磁弁あり)
測定レンジ	CAL (Air校正レンジ) ①Hタイプ: 0-2%, 0-2,000ppm, 0-200ppm ②Lタイプ: 0-2,000ppm, 0-200ppm, 0-20ppm <ご注文時、①、②いずれか選択>
精度 (再現性)	±3% F.S.
応答速度	20秒以内 (90%応答)
アナログ出力	DC 0-20mA, 4-20mA, 0-100mV (要指定)
アラーム接点	2設定×2回路 プザー内蔵 (無電圧c接点、容量240V, 3A)
デジタル表示器	3-1/2桁デジタルLED
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 35W
ガス出入口継手	Rc1/8 (メネジ)
周囲温度	0~40℃
寸法 / 重量	約376 (W) × 330 (D) × 177 (H) mm 約8.5kg

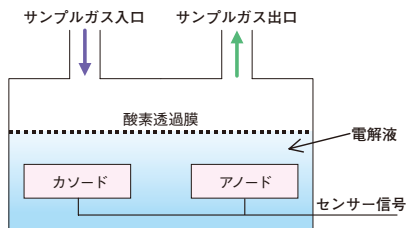
サンプルガス条件

測定ガス	Na ₂ , Ar (注) 次のようなガスが含まれている場合、センサーが影響を受け、故障するか、酸素指示が正常に出ない可能性があります: CO、その他酸性ガス、可燃性ガス、ハロゲン化合物、有機溶剤、半導体材料ガス等
測定ガス流量	0.5ℓ/min.(規定範囲 0.3~1ℓ/min.)
測定ガス圧力	大気圧 (max. 9.8kPaG 以下)
測定ガス温度	-5~45℃
水分	Dry (-60℃ D.P. 以下)
ダスト	無し (フィルター等で除去)

※仕様及び外観は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承願います。

測定原理

クラーク型ガルバニ電池式センサーは、アノード電極、カソード電極、酸素透過膜、電解液で構成されています。センサーに導入されたサンプルガス中の酸素は酸素透過膜を通過し、カソード電極上で水酸化イオン(OH⁻)に還元され、アノード電極で酸化されます。両極における電気化学反応により、センサーに導入されたガス中の酸素濃度に比例した電気信号を発生し、増幅回路を通して酸素濃度を表示しています。



分析機器部はISO9001の認証を取得しています。

※本分析計の保証範囲は、納入品に限定し、納入品の故障に起因する損害、事故の補償は致しかねます。予めご了承ください。

お問い合わせ

日本エア・リキード株式会社

工業事業本部

■ 分析機器部

〒108-8509 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー

TEL: 03-6414-6751 FAX: 03-5232-4310

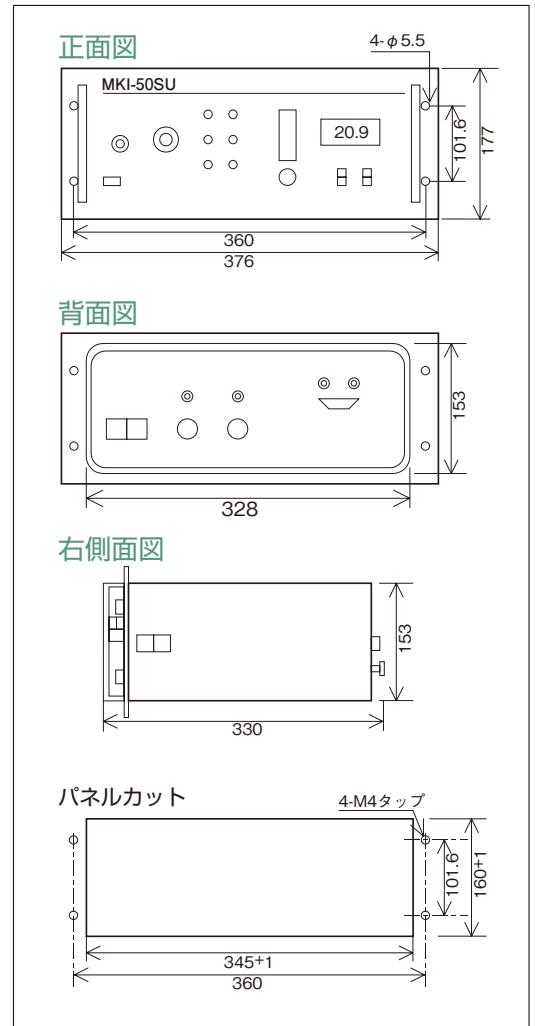
■ 筑波テクノロジーセンター

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-8

TEL: 029-847-9803 FAX: 029-847-9804

外形図

(単位: mm)



アプリケーション例

